

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和3年11月4日(2021.11.4)

【公表番号】特表2020-523570(P2020-523570A)

【公表日】令和2年8月6日(2020.8.6)

【年通号数】公開・登録公報2020-031

【出願番号】特願2019-567253(P2019-567253)

【国際特許分類】

G 01 N 1/34 (2006.01)

C 12 M 1/00 (2006.01)

G 01 N 1/28 (2006.01)

【F I】

G 01 N 1/34

C 12 M 1/00 A

G 01 N 1/28 J

【手続補正書】

【提出日】令和3年9月24日(2021.9.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

常磁性粒子を、液体／気体界面を横切って移動させる方法であって、

(a) 常磁性粒子(PMP)を含有する液体サンプルを準備することと、

(b) 前記PMPのペレットを形成するよう、前記液体サンプル内に磁場を形成することと、

(c) 前記液体／気体界面に隣接した当該液体内に前記ペレットを位置させるよう、前記磁場を位置決めすることと、

(d) 前記PMPが遭遇した前記磁場を減少または除去することと、

(e) 前記液体／気体界面の当該気体側に磁場を形成することと、

(f) 前記PMPのペレットを、前記液体／気体界面を横切って当該気体内に流すことと

を含む、

方法。

【請求項2】

前記PMPを、移送表面の近位側においてペレット化して流すために、移動可能な磁石を当該移送表面の遠位側に隣接して配置する、

請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記磁場を形成することには、

前記移送表面の遠位側の近傍、あるいは前記移送表面の遠位側に対して、前記磁石を位置させることを含む、

請求項2に記載の方法。

【請求項4】

前記PMPが遭遇した前記磁場を減少または除去することには、

前記移送表面から前記磁石を離すことを含む、

請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記 P M P は、表面に捕捉剤を示している、

請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

前記捕捉剤は、核酸プローブ、抗体または抗体断片、または親和剤である、

請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記捕捉剤は、検体に結合する、

請求項 5 に記載の方法。

【請求項 8】

(g) 前記気体内にある前記ペレットを移動させて気体 / 液体界面に隣接させるように前記磁場を位置決めすることと、

(h) 前記 P M P が遭遇した前記磁場を減少または除去することと、

(i) 前記気体 / 液体界面の当該液体側に磁場を形成することと、

(j) 前記気体 / 液体界面を横切って当該液体にペレット化した P M P を流すこととを更に含む、

請求項 1 に記載の方法。